



一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法

文献类型: 专利

.....

作者 施海亮¹; 李大成¹; 方勇华¹; 吴军¹; 罗海燕¹; 熊伟¹

发表日期 2010

专利国别 中国

专利号 101762323A

专利类型 发明

权利人 中国科学院安徽光学精密机械研究所

公开日期 2013-01-08

申请日期 2010

专利申请号 201010046536.9

源URL [<http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/8908>]

专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

推荐引用方式 施海亮,李大成,方勇华,等. 一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法,一种空间外差干涉仪光栅的胶合检测方法. 101762323A. 2010-01-01.

入库方式: OAI收割

来源: [合肥物质科学研究院](#)

浏览	下载	收藏
313	106	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

